

聚焦离子束（FIB）

仪器基本信息	
仪器中文名	聚焦离子束
仪器英文名	Focused Ion Beam
仪器型号	Scios
生产厂家	FEI
工作状态	正常
	
主要技术指标	
加速电压	离子束：500V~30kV，电子束：200V~30kV
离子源种类	液态 Ga 离子源
分辨率	离子束：≤5nm@30kV；电子束≤1.0nm@15kV，≤1.6nm@1kV
探针电流	≤65nA（FIB）；1pA~400nA（SEM）
主要配置与附件	
金属沉积系统	可在离子束、电子束诱导下进行 Pt 等金属的沉积
可用探头	二次电子探测器、高分辨背散射电子探测器
敏感样品传输系统	防止样品转移过程中造成的污染
功能用途及样品要求	
功能及特点	主要材料的剥离、沉积、注入等加工工艺；除聚焦离子束（FIB）的功能外，兼具扫描电子显微镜（SEM）的成像功能。主要功能：TEM 透射电镜样品制备，SEM 扫描电子显微镜结构分析—可以进行二次电子形貌分析、背散射衬度分析。微纳结构加工：Easylift 纳米操作手、离子束切割等的配合下，可以进行各种微纳材料的搬运和加工。
测样要求	非磁性块体和粉末材料
联系方式	
仪器安放地点	深圳大学城北大园区 B 栋 110
仪器负责人	付少杰
联系电话	158 1869 1906
Email	fusj@pkusz.edu.cn
仪器预约与收费标准	
预约说明	接受校内预约，校外预约请直接联系仪器负责人
收费说明	见价目表